

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
22. Februar 2001 (22.02.2001)

PCT

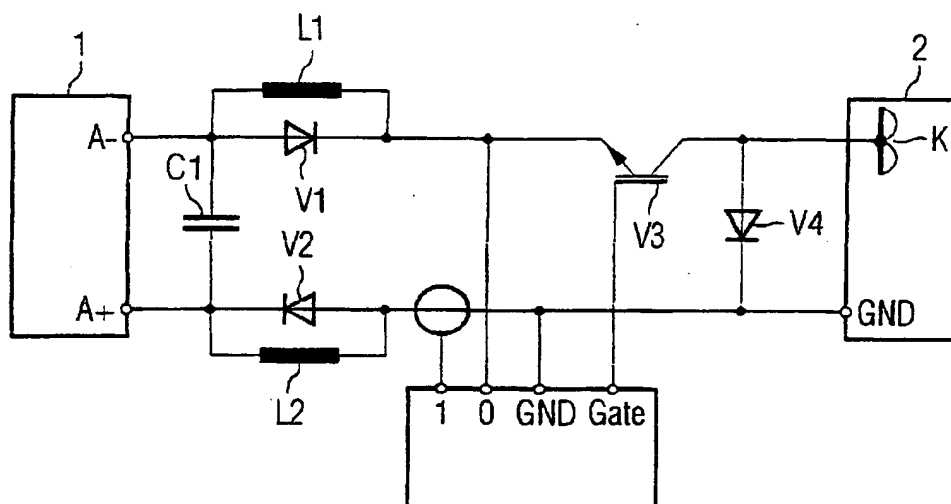
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
WO 01/13402 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation<sup>7</sup>: H01J 37/32  
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/02741  
(22) Internationales Anmeldedatum: 13. August 2000 (13.08.2000)  
(25) Einreichungssprache: Deutsch  
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch  
(30) Angaben zur Priorität: 199 37 859.2 13. August 1999 (13.08.1999) DE  
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): HÜTTINGER ELEKTRONIK GMBH & CO. KG [DE/DE]; Elsässer Strasse 8, 79110 Freiburg (DE).  
(72) Erfinder; und  
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ZÄHRINGER,  
(74) Anwalt: MÜNICH, Wilhelm; Dr. Münich & Kollegen, Wilhelm-Mayr-Strasse 11, 80689 München (DE).  
(81) Bestimmungsstaat (national): US.  
(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).  
Veröffentlicht:  
— Mit internationalem Recherchenbericht.  
— Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist: Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ELECTRIC SUPPLY UNIT FOR PLASMA INSTALLATIONS

(54) Bezeichnung: ELEKTRISCHE VERSORGUNGSEINHEIT FÜR PLASMAANLAGEN



(57) Abstract: The invention relates to an electric supply unit for plasma installations, such as plasma processing or plasma coating devices, in which arcs or disruptive discharges can occur between the electrodes. The inventive power supply unit comprises a direct voltage or direct current source (1) whose output terminals are connected to the electrodes of the plasma installation (2) via at least one inductor and one power circuit breaker (V3). The inventive unit also comprises a circuit (3) for identifying arcs or disruptive discharges which, in the instance of an arc or disruptive discharge, actuates the power circuit breaker in such a way that electric power is no longer applied to the electrodes. The invention is characterized in that the inductor(s) (L1, L2) is/are interconnected to a recovery diode (V1, V2), and in that the power circuit breaker is a series switch (V3).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

BEST AVAILABLE COPY



*Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.*

---

**(57) Zusammenfassung:** Beschrieben wird elektrische Versorgungseinheit für Plasmaanlagen, wie Plasma-Bearbeitungs- bzw. Beschichtungsvorrichtungen, bei denen es zum Auftreten von Lichtbögen bzw. Durchschlägen (Arcs) zwischen den Elektroden kommen kann, mit einer Gleichspannungs- bzw. Gleichstromquelle (1), deren Ausgangsanschlüsse über wenigstens eine Induktivität und einen Leistungsschalter (V3) mit den Elektroden der Plasmaanlage (2) verbunden sind, und einer Schaltung (3) zum Erkennen von Lichtbögen bzw. Durchschlägen, die beim Auftreten eines Lichtbogens bzw. Durchschlags den Schalter derart betätigt, dass keine elektrische Energie mehr an die Elektroden angelegt wird. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Induktivität(en) (L1, L2) jeweils mit einer Freilaufdiode (V1, V2) beschaltet ist (sind), und dass der Schalter ein Serienschalter (V3) ist.

## **Elektrische Versorgungseinheit für Plasmaanlagen**

---

### **BESCHREIBUNG**

#### **Technisches Gebiet**

Die Erfindung bezieht sich auf eine elektrische Versorgungseinheit für Plasmaanlagen, wie Plasma-Bearbeitungs- bzw. Beschichtungsvorrichtungen, bei denen es zum Auftreten von Lichtbögen bzw. Durchschlägen (Arcs) insbesondere zwischen den Elektroden kommen kann, gemäß dem Oberbegriff der unabhängigen Patentansprüche.

Plasmaanlagen, für die die gattungsgemäßen elektrischen Versorgungseinheiten bestimmt sind, haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und werden beispielsweise zum Besputtern von Targets eingesetzt. In der Regel haben sie eine elektrische Leistung in der Größenordnung von ca. einigen kW bis zu mehr als 100 kW. Die an die Elektroden angelegte Betriebsspannung liegt dabei typischerweise in der Größenordnung von 400 V. Selbstverständlich sind dabei Abweichungen nach oben oder unten - auch in Abhängigkeit von der Anwendung - möglich.

Insbesondere beim sogenannten "reaktiven" Sputtern, das zum Beispiel zur Herstellung von Oxid- oder Nitrid-Filmen verwendet wird, oder bei der Verwendung reaktiver Gase ergeben sich Probleme durch das Auftreten von Durchschlägen und/oder die Bildung isolierender Schichten auf dem leitenden Target, durch die sich parasitäre Kondensatoren ausbilden können.

### Stand der Technik

Es sind die verschiedensten passiven und aktiven Schaltungen bekannt, die zum Löschen von Lichtbögen dienen, die sich aufgrund von Durchschlägen gebildet haben. Allen diesen Schaltungen ist gemeinsam, daß für einen bestimmten Zeitraum die an die Elektroden angelegte Spannung abgeschaltet wird. Nur exemplarisch wird hierzu auf die US-PSen 4,692,230, 5,009,764, 5,015,493 und 5,682,067 verwiesen, auf die im übrigen zur Erläuterung aller hier nicht näher beschriebenen Einzelheiten und Anwendungsmöglichkeiten ausdrücklich Bezug genommen wird.

Die US-PS 5,682,067 beschreibt im übrigen den Stand der Technik, von dem bei der Formulierung des Oberbegriffs der unabhängigen Patentansprüche ausgegangen worden ist.

Nachteilig bei den aus diesen Druckschriften bekannten Schaltungen ist, daß nach dem Wiedereinschalten der Betriebsspannung das System eine vergleichsweise lange Zeit benötigt, um wieder mit "voller Leistung sputtern" oder das Target in anderer Weise bearbeiten zu können.

Entsprechendes gilt, wenn das System in einem sogenannten asymmetrischen Pulsbetrieb betrieben wird, um die Bildung von isolierenden Schichten auf dem Target zu verhindern.

Weiterhin ist es bekannt, die an die Elektroden angelegte Spannung periodisch - unabhängig davon ob ein Durchschlag oder ein Lichtbogen auftritt - für einen kurzen Zeitraum abzuschalten. Bei dieser Vorgehensweise

muß die Einschaltdauer so gewählt werden, daß während der Zeit, während der die Spannung angelegt ist, kein Durchschlag bzw. kein Lichtbogen auftritt. Damit kann zwar das Auftreten von Durchschlägen bzw. Lichtbögen verhindert werden, durch das periodische Abschalten und das anschließende Wiederanlegen der Spannung wird die Effizienz der Anlage jedoch deutlich reduziert.

#### **Darstellung der Erfindung**

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine elektrische Versorgungseinheit für Plasmaanlagen anzugeben, bei der nach dem Wiederanlegen der Betriebsspannung an die Elektroden das System möglichst schnell seine volle Leistung erreicht, und/oder bei der die Effizienzverringerung durch das Auftreten von Lichtbögen bzw. Durchschlägen beispielsweise durch das "prophylaktische" Abschalten der Betriebsspannung möglichst gering ist.

Erfindungsgemäße Lösungen dieser Aufgabe sind in den Patentansprüchen 1 bzw. 18 angegeben. Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Erfindungsgemäß wird von einer elektrischen Versorgungseinheit ausgegangen, die eine Gleichspannungs- bzw. Gleichstromquelle, deren Ausgangsanschlüsse über wenigstens eine Induktivität und einen Leistungsschalter mit den Elektroden der Plasmaanlage verbunden sind, und gegebenenfalls eine Schaltung zum Erkennen von Lichtbögen bzw. Durchschlägen aufweist, die beim Auftreten eines Lichtbogens bzw. eines Durchschlags den

Schalter derart betätigt, daß keine elektrische Energie mehr an die Elektroden angelegt wird.

Ausgehend von einer derartigen, bekannten Versorgungseinheit besteht die Erfindung darin, daß die Induktivität(en) jeweils mit einer Freilaufdiode beschaltet ist (sind), und daß der Schalter ein Serienschalter ist.

Aufgrund dieser Ausbildung arbeitet die erfindungsgemäße Versorgungseinheit wie folgt:

Der Schalter, der die an die Elektroden angelegte elektrische Leistung schaltet (im folgenden auch als Leistungsschalter bezeichnet), öffnet beim Erkennen eines Lichtbogens den Stromfluß zwischen der Gleichspannungsquelle und den Elektroden. Die Dioden, die bezogen auf die normale Betriebsspannung in Sperrrichtung geschaltet sind, verhindern beim Öffnen des Leistungsschalters, daß die Spannungen an den Induktivitäten ansteigen und bewirken gleichzeitig, daß der Strom in den Induktivitäten nur sehr langsam abnimmt. Wird der Leistungsschalter bereits nach kurzer Zeit - typisch sind etwa einige Millisekunden - wieder eingeschaltet, so steht der in den Induktivitäten gespeicherte Strom sofort zur Verfügung, so daß das System schneller als beim Stand der Technik seine volle Leistung erreicht. Die erfindungsgemäße Versorgungseinheit hat damit beim Wiedereinschalten des Leistungsschalters eine Stromquellencharakteristik.

Damit sind bei der erfindungsgemäßen elektrischen Versorgungseinheit die Einbußen in der Leistung aufgrund

des Abschaltens der Betriebsspannung zur Löschung von Lichtbögen wesentlich geringer als beim Stand der Technik.

Diese erfindungsgemäße - im Anspruch 1 angegebene - Grundschialtung kann unter verschiedenen Aspekten, die auch miteinander kombiniert werden können, erweitert werden:

Insbesondere ist es möglich, in jeder Leitung, die einen Anschluß der Gleichspannungs- bzw. Gleichstromquelle mit der jeweils zugeordneten Elektrode verbindet, eine Induktivität mit einer zugeordneten Freilaufdiode vorzusehen. Hierdurch erhält man einen besonders symmetrischen Schaltungsaufbau. Es ist jedoch möglich, nur eine Induktivität zu verwenden; in diesem Falle ist auch nur eine Freilaufdiode erforderlich.

Als Schalter können selbstverständlich die unterschiedlichsten Leistungsschalter verwendet werden. Im Hinblick auf die hohe Leistung ist es jedoch bevorzugt, wenn der Schalter ein IGBT ist.

Auch als Netzteil können die unterschiedlichsten Netzteile eingesetzt werden, ebenfalls im Hinblick auf die hohe Leistung ist es jedoch bevorzugt, wenn die Gleichspannungsquelle ein Schaltregler-Netzteil ist.

In diese Falle ist es von Vorteil, wenn zwischen die Anschlüsse der Gleichspannung- bzw. Gleichstromquelle ein Kondensator geschaltet ist. Dieser Kondensator dient zur Vermeidung von Spannungsspitzen, die durch

die Zuleitungsinduktivitäten in der Versorgungseinheit auftreten können. Weiterhin wird dieser Kondensator in der Zeit, in der der Leistungsschalter abgeschaltet ist, auf die volle Leerlaufspannung aufgeladen, so daß beim Durchschalten des Leistungsschalters die volle Spannungen zum Zünden des Plasmas zur Verfügung steht.

Die erfindungsgemäße Versorgungseinheit läßt sich für die verschiedensten Plasmaanlagen einsetzen, wie beispielsweise Plasmaanlagen, bei denen die eine Elektrode wenigstens eine in einer Plasmakammer angeordnete Kathode aufweist, und die andere Elektrode das Gehäuse der Plasmakammer ist. Die erfindungsgemäße Versorgungseinheit hat darüberhinaus den besonderen Vorteil, daß es auch für Plasmaanlagen verwendbar ist, bei denen wenigstens zwei voneinander getrennte Kathoden vorgesehen sind, von denen jede über einen Serienschalter mit der mit einer Freilaufdiode beschalteten Induktivität an dem einen Anschluß der Gleichspannungsquelle verbunden ist.

Bei derartigen Systemen kann beispielsweise zwischen den Kathoden alternierend umgeschaltet werden. Dies hat den Vorteil, daß Lichtbögen, die an der einen Kathode "im Entstehen" sind, zuverlässig in dem vergleichsweise langen Zeitraum gelöscht werden, während dem auf die andere Kathode umgeschaltet wird. Selbstverständlich ist es aber auch möglich, gleichzeitig von mehreren Kathoden zu sputtern.

Bei einer Weiterbildung der Erfindung ist zwischen die Elektrodenanschlüsse bzw. die Elektrodenpaare eine



Diode geschaltet. Die Funktion dieser Diode wird im folgenden erläutert:

Beim Öffnen des Leistungsschalters polt die Spannung an den Zuleitungsinduktivitäten zur Plasmakammer um, so daß sich ohne weitere Schaltungsmaßnahmen Spannungsspitzen ergeben würden. Die zwischen die Elektrodenanschlüsse geschaltete Diode schließt diese Spannung kurz, so daß die in den Zuleitungsinduktivitäten gespeicherte Energie abgebaut wird.

Weiterhin ist es möglich, ein LC-Glied parallel zu der Diode zu schalten, das als passives Element die Löschung des Lichtbogens unterstützt.

Besonders bevorzugt ist es jedoch, wenn die Löschung des Lichtbogens durch aktive Schaltungselemente unterstützt wird:

Hierzu kann in Reihe mit der Diode ein Kondensator geschaltet sein. Zwischen Kathodenanschluß und den Verbindungspunkt Diode/Kondensator ist dann ein weiterer Serienschalter geschaltet. Durch diesen Schaltungsaufbau wird die sich aus der Leitungsinduktivität und dem fließenden Strom ergebende Energie beim Öffnen des Leistungsschalters als Spannung in den Kondensator umgeladen. Nach einer kurzen Verzögerung wird diese Spannung über den weiteren Serienschalter an die Elektroden angelegt, so daß der Lichtbogen wesentlich schneller als bei einer passiven Schaltung gelöscht wird.

Um auch bei kleinen Leitungsinduktivitäten oder kleinen Strömen eine entsprechend große invertierte Spannung zum Löschen zu erhalten, kann ferner eine Inversspannungsquelle vorgesehen werden.

Diese Inversspannungsquelle kann insbesondere eine (Hilfs)-Gleichspannungsquelle sein, deren Minuspol mit der Anode und deren Pluspol über eine in Vorwärtsrichtung geschaltete Diode mit dem einen Anschluß des weiteren Serienschalters verbunden ist.

In jedem Falle ist es bevorzugt, wenn die Schaltung zum Erkennen von Lichtbögen außer dem Leistungsschalter auch den weiteren Schalter ansteuert.

Die Schaltung zum Erkennen von Lichtbögen kann dabei wenigstens eines der folgenden Kriterien auswerten:

- Spannungseinbruch,
- Überschreiten der Maximum-Spannungsgrenze,
- Unterschreiten der Minimum-Spannungsgrenze
- Schneller Stromanstieg,
- Überschreiten der Maximum-Stromgrenze.

Weiterhin kann in an sich bekannter Weise eine Steuereinheit, die insbesondere Bestandteil der Schaltung zum Erkennen von Lichtbögen sein kann, vorgesehen sein, die „prophylaktisch“ mit einer festen Periode die an die Elektroden angelegte Spannung ab- und bevorzugt umschaltet. Wird die an die Elektroden angelegte Spannung regelmäßig für einen kurzen Moment umgepolt, so kann die Entstehung von Lichtbögen wesentlich verringert

werden bzw. können Lichtbögen schon in der Entstehung wieder gelöscht werden.

Aufgrund der erfindungsgemäßen Ausbildung, die nach dem Wiederanschalten zu einem schnellen Erreichen der Leistung führt, führt das regelmäßige Umpolen der Spannung nur zu einer sehr geringen Reduzierung der Sputterleistung, sofern die Zeitdauer, während der die an die Elektroden angelegte Spannung umgeschaltet wird, wesentlich kürzer als die Zeitdauer ist, während der ein Plasmabetrieb ausgeführt wird. Weiterhin muß die Zeitdauer, während der die Spannung umgeschaltet wird, natürlich auch so kurz sein, daß der Strom in dem Kreis „Induktivität/Freilaufdiode“ gespeichert wird.

Die Frequenz, mit der die Steuereinheit die an die Elektroden angelegte Spannung ab- bzw. umschaltet, kann dabei bis zu 100 kHz betragen.

Anstelle einer periodischen prophylaktischen Umschaltung mit einer festen Periode, die unabhängig von den Prozeßparametern und der hiervon abhängigen Häufigkeit von Lichtbögen bzw. Durchschlägen ist, ist es jedoch bevorzugt, wenn die Steuereinheit in Art einer adaptiven Regelung die Einschaltdauer der Spannung so einstellt, daß "gerade" kein Lichtbogen bzw. Durchschlag auftritt. Bei dieser weiteren Lösung der erfindungsgemäß gestellten Aufgabe, die auch zusätzlich zu der Lösung gemäß Anspruch 1 verwendet werden kann, ist es von Vorteil, wenn eine Steuer- bzw. Regeleinheit vorgesehen ist, die beim Auftreten eines Lichtbogens bzw. Durchschlags diesen durch Abschalten der an die Elektroden

angelegten Spannung oder Umschalten auf eine Inversspannung für eine bestimmte Zeitdauer (Ausschaltdauer) löscht, und daß die Steuer- bzw. Regeleinheit nach dem Auftreten wenigstens eines Lichtbogens bzw. Durchschlags die Einschaltdauer der einen Plasmabetrieb hervorruhenden Spannung verringert.

Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn die Steuer- bzw. Regeleinheit die Einschaltdauer auf eine Zeitdauer verringert, die kleiner als der aktuelle Zeitabstand zwischen zwei nacheinander auftretenden Lichtbögen bzw. Durchschlägen ist. Da sich die Betriebsparameter einer Anlage während eines Bearbeitungsvorgangs ändern können, ist es weiterhin bevorzugt, wenn die Steuer- bzw. Regeleinheit die Einschaltdauer auch vergrößert:

Hierzu ist es beispielsweise möglich, daß die Steuer- und Regeleinheit die Einschaltdauer vergrößert, wenn über einen bestimmten Zeitraum bzw. über eine bestimmte Zahl von Einschaltperioden kein Lichtbogen bzw. Durchschlag oder nur eine bestimmte Zahl von Lichtbögen bzw. Durchschlägen aufgetreten ist. Die Steuer- und Regeleinheit kann die Einschaltdauer dabei bis zum CW-Betrieb verlängern.

Um das zufällige Auftreten von Arcs bei der adaptiven Regelung nicht so stark zu gewichten, ist es ferner bevorzugt, wenn die Steuer- bzw. Regeleinheit die Einschaltdauer nur dann verringert, wenn während einer bestimmten Zeit eine gewisse Zahl von Lichtbögen bzw. Durchschlägen aufgetreten ist.

Weiterhin ist es bevorzugt, wenn die Steuer- bzw. Regeleinheit beim Beginn des Plasmabetriebs die an die Elektroden angelegte Spannung entweder dauernd oder für eine bestimmte (vor Beginn des Prozesses vorgebbare) Einschaltdauer einschaltet, dann für eine bestimmte Ausschaltdauer ab- oder bevorzugt umschaltet, und sodann die Spannung wieder einschaltet, und beim Auftreten von Lichtbögen bzw. Durchschlägen die Einschaltdauer der Spannung verringert.

Um die erfindungsgemäße Versorgungseinheit an die unterschiedlichsten Bearbeitungs- bzw. Aufbringvorgänge anpassen zu können, ist es ferner von Vorteil, wenn die anfänglichen Werte der Einschaltdauer und der Ausschaltdauer und/oder die Zahl von Lichtbögen bzw. Durchschlägen sowie die Zeiteinheit, in denen diese Zahl auftritt, einstellbar sind.

In jedem Falle ist es ferner von Vorteil, wenn die Einschaltdauer mit der Häufigkeit des Auftretens von Lichtbögen bzw. Durchschlägen über eine variable Kennlinie verknüpft ist, die von weiteren Prozeßparametern abhängig sein kann.

Um die Reduzierung der Leistung der Plasmaanlage so gering wie möglich zu halten, ist es ferner von Vorteil, wenn die Steuer- bzw. Regeleinheit die Ausschaltdauer bzw. die Umschaltdauer optimiert. Die Aus- bzw. Umschaltdauer wird dabei „gerade“ so lang eingestellt, daß der Lichtbogen bzw. Durchschlag (Arc) „nachhaltig“ gelöscht wird.

**Kurze Beschreibung der Zeichnung**

Die Erfindung wird nachstehend unter Bezugnahme auf die Zeichnung näher beschrieben, in der zeigen:

- Fig. 1     die Schaltung eines ersten Ausführungsbeispiels der Erfindung,
- Fig. 2     ein Spannungs/Zeit-Diagramm zur Erläuterung der Funktionsweise der in Fig. 1 gezeigten Schaltung,
- Fig. 3     die Schaltung eines zweiten Ausführungsbeispiels der Erfindung,
- Fig. 4     ein Spannungs/Zeit-Diagramm zur Erläuterung der Funktionsweise der in Fig. 3 gezeigten Schaltung,
- Fig. 5     ein Spannungs/Zeit-Diagramm zur Erläuterung der Funktionsweise einer Modifikation der in Fig. 3 gezeigten Schaltung,
- Fig. 6     die Schaltung eines dritten Ausführungsbeispiels der Erfindung,
- Fig. 7     ein Spannungs/Zeit-Diagramm zur Erläuterung der Funktionsweise des dritten Ausführungsbeispiels, und
- Fig. 8     ein Blockschaltbild eines vierten Ausführungsbeispiels, und

Fig. 9 eine Darstellung zur Erläuterung der Funktionsweise des vierten Ausführungsbeispiels.

#### Darstellung von Ausführungsbeispielen

Fig. 1 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die Energieversorgungseinheit weist ein Schaltregler-Netzteil 1 auf, das beispielsweise (d.h. ohne Beschränkung der Allgemeinheit) eine Gleichspannung von ca. 400 V liefert. Der negative Ausgangsanschluß A- des Netzteils 1 ist über eine Induktivität L1 und einen als Serienschalter ausgebildeten Leistungsschalter V3 mit einer Kathode K in einer Plasmakammer 2 verbunden, deren Gehäuse geerdet ist. Der Serienschalter 1 ist bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ein IGBT. Der positive Ausgangsanschluß A+ des Netzteils 1 ist über eine Induktivität L2 mit dem Gehäuse der Plasmakammer 2 verbunden. Dies ist symbolisch mit GND bezeichnet.

Parallel zu den Induktivitäten L1 und L2 sind erfindungsgemäß Dioden V1 bzw. V2 geschaltet, die derart gepolt sind, daß sie beim Plasmabetrieb sperren.

Ferner ist zwischen die Ausgangsanschlüsse A- und A+ ein Kondensator C1 geschaltet. Zwischen den Kathodenanschluß und GND ist eine Diode V4 geschaltet, die beim Plasmabetrieb in Sperrrichtung gepolt ist.

Weiterhin ist eine Schaltung 3 zum Erkennen von Lichtbögen bzw. Durchschlägen vorgesehen, die den Serienschalter V3 über den Ausgangsanschluß „Gate“ steuert. Um einen Lichtbogen - auch als Arc bezeichnet - zu erkennen, mißt die Schaltung 3 den fließenden Strom I und

die Spannung  $U$  und wertet die gemessenen Größen nach folgenden Kriterien aus:

- Spannungseinbruch,
- Überschreiten der Maximum-Spannungsgrenze,
- Unterschreiten der Minimum-Spannungsgrenze
- Schneller Stromanstieg,
- Überschreiten der Maximum-Stromgrenze.

Beim Erkennen eines Lichtbogens wird der Leistungsschalter  $V3$  von der Schaltung 3 geöffnet, so daß der Stromfluß zwischen dem Netzteil 1 und den Elektroden der Plasmakammer 2 unterbrochen wird. Beim Öffnen des Leistungsschalters polt die Spannung an den Zuleitungsinduktivitäten zur Plasmakammer 2 um; um zu vermeiden, daß dies zu Spannungsspitzen führt, werden die Elektroden über die Diode  $V4$  kurzgeschlossen und die in den Zuleitungsinduktivitäten gespeicherte Energie abgebaut. Die Dioden  $V1$  und  $V2$  verhindern zum einen, daß die Spannungen an den Induktivitäten  $L1$  und  $L2$  beim Öffnen des Leistungsschalters ansteigen und bewirken gleichzeitig, daß der Strom in den Induktivitäten nur sehr langsam abnimmt. Die Induktivitäten  $L1$  und  $L2$  können auch magnetisch gekoppelt sein. Der Kondensator  $C1$  dient zur Vermeidung von Spannungsspitzen, die durch die Zuleitungsinduktivitäten auftreten können.

Im folgenden soll die Funktionsweise der in Fig. 1 gezeigten elektrischen Versorgungseinheit unter Bezugnahme auf Fig. 2, in der ein Spannungs/Zeit-Diagramm dargestellt ist, näher beschrieben werden:



Zum Zeitpunkt T1 bricht die Spannung U aufgrund eines Lichtbogens auf die für einen Lichtbogen bzw. Durchschlag typische Spannung  $U_{ARC}$  ein. Nach der einstellbaren Verzögerungszeit T1-T2 wird der Schalter V3 geöffnet und die Energiezufuhr unterbrochen. Nach der einstellbaren Lichtbogen-Pause T2-T3 wird der Schalter V3 wieder geschlossen, die Spannung steigt bis auf die Zündspannung  $U_{ZÜND}$  an und bricht wieder auf die Brennspannung  $U_{PLASMA}$  zurück.

Durch die erfindungsgemäß vorgesehenen Freilaufdioden V1 und V2 wird der Generator-Ausgangsstrom zum Zeitpunkt des Abschaltens gespeichert, so daß beim Wiedereinschalten der ursprüngliche Betriebszustand sehr schnell wieder erreicht wird.

Fig. 3 zeigt eine Modifikation des in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiels. Dabei sind gleiche Teile wie in Fig. 1 mit den selben Bezugszeichen versehen, so daß auf eine erneute Vorstellung verzichtet wird.

Bei diesem Ausführungsbeispiel ist in Reihe mit der Diode V4 ein Kondensator C2 geschaltet. Zwischen den Anschluß der Kathode K und den Verbindungspunkt Diode V4/Kondensator C2 ist ein weiterer Serienschalter V5 geschaltet, der ebenfalls von der Schaltung 3 über den Ausgangsanschluß Gate2 angesteuert wird.

Weiterhin kann optional eine Inversspannungsquelle vorgesehen sein, die eine (Hilfs)-Gleichspannungsquelle U1 aufweist, die typischerweise eine Spannung von etwa 30 V liefert. Der Minuspol der Gleichspannungsquelle U1

ist mit der Anode verbunden, während der Pluspol der Gleichspannungsquelle U1 über eine im Vorwärtsrichtung geschaltete Diode V6 mit dem einen Anschluß des weiteren Serienschalters V5 verbunden ist.

Im folgenden wird die Funktionsweise des in Fig. 3 gezeigten zweiten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf Fig. 4 näher erläutert, die ein Spannungs/Zeit-Diagramm zeigt.

Beim Auftreten eines Lichtbogens (Zeitpunkt T1) bricht die Spannung von der Plasma-Spannung  $U_{\text{Plasma}}$  auf die Lichtbogen-Spannung  $U_{\text{Arc}}$  zusammen. Daraufhin öffnet die Schaltung 3 den Leistungsschalter V3. Durch den mit der Diode V4 in Reihe geschalteten Kondensator C2 wird die sich aus der Leitungsinduktivität und dem Strom ergebende Energie als Spannung in den Kondensator C2 umgeladen. Zum Zeitpunkt T2 wird diese Spannungen als Inversspannung an die Elektroden der Plasmakammer 2 angelegt, so daß der Lichtbogen wesentlich schneller als ohne aktive Löschung gelöscht wird. Durch die optionale Spannungsquelle U1 kann die angelegte Inversspannung erhöht werden.

Versieht man die Schaltung 3 mit einem zusätzlichen Pulsgenerator, so kann die an die Plasmakammer angelegte Spannung nicht nur beim Auftreten eines Arcs, sondern regelmäßig für einen kurzen Moment umgepolt werden. Hierdurch kann die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Lichtbögen wesentlich verringert werden bzw. Lichtbögen können schon in der Entstehung wieder gelöscht werden.

Zusätzlich wird verhindert, daß sich beim reaktiven Sputtern Oxidschichten auf dem Target bilden; weiterhin können oxidierte Targets freigesputtert werden.

Fig. 5 zeigt schematisch den Spannungsverlauf für diese Modifikation des in Fig. 3 gezeigten Ausführungsbeispiels. Die Pulsfrequenzen können je nach verwendetem Leistungsschalter bis zu 100 kHz betragen.

Fig. 6 zeigt die Schaltung eines dritten Ausführungsbeispiels der Erfindung, bei der in der Plasmakammer 2 zwei Kathoden K1 und K2 angeordnet sind, denen jeweils eigene Leistungsschalter V3 und V5 und Dioden V4 und V6 zugeordnet sind.

Durch gleichzeitiges Einschalten der Leistungsschalter V3 und V5 arbeiten die beiden Kathoden im Parallelbetrieb. Werden die beiden Schalter abwechselnd eingeschaltet, kann durch Variationen der Einschaltzeiten die effektive Leistung der Kathoden geregelt werden. Es sind Umschaltfrequenzen bis zu mehreren kHz möglich.

Fig. 7 zeigt ein Spannungs/Zeit-Diagramm, in dem das alternierende Einschalten der beiden Schalter schematisch dargestellt ist. Selbstverständlich können auch mehr als zwei Kathoden eingesetzt werden.

Fig. 8 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel der Erfindung, bei dem die Leistungsminderung, die sich bei der Vorgehensweise gemäß Fig. 5 durch das prophylaktische Umschalten der Spannung mit einer festen, vorgegebenen Frequenz ergibt, deutlich reduziert wird:

Bei diesem Ausführungsbeispiel ist die Schaltung 3 durch eine adaptive Regeleinheit 4 mit einer Startwertvorgabeeinheit 5 ergänzt.

Aufgrund der Verwendung einer adaptiven Regeleinheit 4 ist die Einschaltdauer der an die Elektroden angelegten Spannung nicht fest vorgegeben. Im laufenden Betrieb wird durch die adaptive Regeleinheit 4 eine möglichst hohe Einschaltdauer eingestellt, um den Plasmaprozeß in einer Plasmaanlage 6 nicht durch unnötige Austastung - wie gemäß Fig. 5 und 7 zu unterbrechen. Treten jedoch Arcs auf, so wird nach dem Löschen des Arcs die Einschaltdauer verkürzt. Damit wird die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines wiederholten Arcs geringer. Tritt trotz der verkürzten Einschaltdauer weiterhin ein Arc auf, wird die Einschaltdauer weiter verkürzt, bis ein stabiler, Arc-freier Betrieb möglich ist. Entsprechend wird die Einschaltdauer verlängert, wenn über eine bestimmte Zeit keine Arcs aufgetreten sind. Die Einschaltdauer wird dann so lange verlängert, bis wiederum Arcs im Prozeß auftreten. Die Verlängerung der Einschaltdauer kann soweit gehen, daß die Anlage im „continuous-Betrieb“ (CW-Betrieb) gefahren wird.

Die Einschaltzeit und die Arc-Häufigkeit können über eine variable Kennlinie der adaptiven Regeleinheit, die von weiteren Prozeßparametern - Prozeßgase, Target- und Sputtermaterialien usw. - abhängig sein kann, miteinander verknüpft bzw. korreliert werden. Fig. 9 zeigt qualitativ eine Kennlinie, die die auf der Abzisse aufgetragene Arc-Häufigkeit (1/s) mit der auf der Ordinate aufgetragenen Einschaltzeit (s) korreliert. Ausdrück-

lich wird darauf hingewiesen, daß entsprechende Kennlinien nicht nur von mehreren Parametern, sondern auch von der Geometrie der Plasmaanlage, den Prozeßmaterialien usw. abhängen. Bevorzugt werden die Kennlinien empirisch ermittelt und/oder von der Regeleinheit 4, die beispielsweise einen Mikroprozessor aufweisen kann, adaptiv eingestellt.

Über die Startwert-Vorgabeeinheit 5 können bestimmte, als vorteilhaft erkannte Werte für die Einschaltdauer sowie die Aus- bzw. Umschaltdauer beim Beginn des Plasmaetriebs vorgegeben oder bestimmte bereits ermittelte Kennlinie gewählt werden.

Durch die Verwendung eines adaptiven Regelalgorithmus werden die Parameter des Arc-Managements an die Prozeßparameter optimal angepaßt. Dabei ist es insbesondere auch möglich, die Aus- bzw. Umschaltdauer optimal - gegebenenfalls auch adaptiv - einzustellen.

Die Erfindung ist vorstehend anhand von Ausführungsbeispielen ohne Beschränkung der Allgemeinheit beschrieben worden. Insbesondere kann die erfindungsgemäße Versorgungseinheit für alle aus der einleitend genannten Literatur bekannten Anwendungen eingesetzt werden. Weiterhin können die verschiedenen Eigenschaften der Ausführungsbeispiele miteinander kombiniert werden: So ist es möglich, den Pulsbetrieb oder die adaptive Regelung, die aktive Löschung von Lichtbögen und das Umschalten zwischen zwei oder mehr Kathoden teilweise oder vollständig miteinander zu kombinieren oder zwischen den einzelnen beschriebenen Betriebsmodi umzuschalten.

PATENTANSPRÜCHE

1. Elektrische Versorgungseinheit für Plasmaanlagen, wie Plasma-Bearbeitungs- bzw. Beschichtungsvorrichtungen, bei denen es zum Auftreten von Lichtbögen bzw. Durchschlägen kommen kann, die insbesondere von einer Elektrode ausgehen, mit
  - einer Gleichspannungs- bzw. Gleichstromquelle, deren Ausgangsanschlüsse über wenigstens eine Induktivität und einen Leistungsschalter mit den Elektroden der Plasmaanlage verbunden sind, und gegebenenfalls
  - einer Schaltung zum Erkennen von Lichtbögen bzw. Durchschlägen, die beim Auftreten eines Lichtbogens bzw. Durchschlags den Schalter derart betätigt, daß keine ein Plasma erzeugende elektrische Energie mehr an die Elektroden angelegt wird,dadurch **gekennzeichnet**, daß die Induktivität(en) (L1, L2) jeweils mit einer Freilaufdiode (V1, V2) beschaltet ist (sind), und daß der Schalter ein Serienschalter (V3) ist.
2. Versorgungseinheit nach Anspruch 1, dadurch **gekennzeichnet**, daß in jeder Leitung, die einen Anschluß der Gleichspannungs- bzw. Gleichstromquelle (1) mit der jeweils zugeordneten Elektrode (Kathode, GND) verbindet, eine Induktivität (L1, L2) mit einer zugeordneten Freilaufdiode (V1, V2) vorgesehen ist.

3. Versorgungseinheit nach Anspruch 1 oder 2,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß der Schalter (V3) ein IGBT ist.
4. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 3,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Gleichspannungsquelle ein Schaltregler-Netzteil (1) ist.
5. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 4,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß zwischen die Anschlüsse (A-, A+) der Gleichspannung- bzw. Gleichstromquelle (1) ein Kondensator (C1) geschaltet ist.
6. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 5,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die eine Elektrode wenigstens eine in einer Plasmakammer angeordnete Kathode aufweist, und die andere Elektrode das Gehäuse der Plasmakammer (GND) ist.
7. Versorgungseinheit nach Anspruch 6,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß wenigstens zwei voneinander getrennte Kathoden (Kathode 1, Kathode 2) vorgesehen sind, von denen jede über einen Serienschalter (V3, V5) mit der mit einer Freilaufdiode beschalteten Induktivität (L1) verbunden ist.
8. Versorgungseinheit nach Anspruch 7,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß zwischen den Kathoden alternierend umgeschaltet wird.

9. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch **gekennzeichnet**, daß zwischen die Elektrodenanschlüsse eine Diode (V4) geschaltet ist.
10. Versorgungseinheit nach Anspruch 9, dadurch **gekennzeichnet**, daß in Reihe mit der Diode (V4) ein Kondensator (C2) geschaltet ist, und daß zwischen Kathodenanschluß und den Verbindungspunkt Diode (V4)/Kondensator (C2) ein weiterer Serienschalter (V5) geschaltet ist.
11. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch **gekennzeichnet**, daß eine Inversspannungsquelle vorgesehen ist.
12. Versorgungseinheit nach Anspruch 11, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Inversspannungsquelle eine (Hilfs)-Gleichspannungsquelle (U1), deren Minuspol mit der Anode und deren Pluspol über eine im Vorwärtsrichtung geschaltete Diode (V6) mit dem einen Anschluß des weiteren Serienschalters (V5) verbunden ist.
13. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Schaltung (3) zum Erkennen von Lichtbögen außer dem Leistungsschalter (V3) auch den weiteren Schalter (V5) ansteuert.



14. Versorgungseinheit nach Anspruch 13,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Schaltung zum Erkennen von Durchschlägen bzw. Lichtbögen (Arcs) wenigstens eines der folgenden Kriterien auswertet:
- Spannungseinbruch,
  - Überschreiten der Maximum-Spannungsgrenze,
  - Unterschreiten der Minimum-Spannungsgrenze
  - Schneller Stromanstieg,
  - Überschreiten der Maximum-Stromgrenze.
15. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 14,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß eine Steuereinheit vorgesehen ist, die periodisch die an die Elektroden angelegte Spannung ab- und bevorzugt umschaltet.
16. Versorgungseinheit nach Anspruch 15,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Frequenz, mit der die Steuereinheit die an die Elektroden angelegte Spannung ab- bzw. umschaltet, bis zu 100 kHz beträgt.
17. Versorgungseinheit nach Anspruch 15 oder 16,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Zeitdauer, während der die an die Elektroden angelegte Spannung umgeschaltet wird, wesentlich kürzer als die Zeitdauer ist, während der ein Plasmabetrieb ausgeführt wird.

18. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 14 oder nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß eine Steuer- bzw. Regeleinheit (4) vorgesehen ist, die beim Auftreten eines Lichtbogens bzw. Durchschlags (Arcs) diesen durch Abschalten der an die Elektroden angelegten Spannung oder Umschalten auf eine Inversspannung für eine bestimmte Zeitdauer (Ausschaltdauer) löscht, und daß die Steuer- bzw. Regeleinheit nach dem Auftreten wenigstens eines Lichtbogens bzw. Durchschlags die Einschaltdauer der einen Plasma-betrieb hervorruhenden Spannung verringert.
19. Versorgungseinheit nach Anspruch 18,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Steuer- bzw. Regeleinheit die Einschaltdauer auf eine Zeitdauer verringert, die kleiner als der aktuelle Zeitabstand zwischen zwei nacheinander auftretenden Lichtbögen bzw. Durchschlägen ist.
20. Versorgungseinheit nach Anspruch 18 oder 19,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Steuer- bzw. Regeleinheit die Einschaltdauer nur dann verringert, wenn während einer bestimmten Zeit eine gewisse Zahl von Lichtbögen bzw. Durchschlägen aufgetreten ist.
21. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 18 bis 20,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Steuer- und Regeleinheit die Einschaltdauer vergrößert, wenn

über einen bestimmten Zeitraum bzw. über eine bestimmte Zahl von Einschaltperioden kein Lichtbogen bzw. Durchschlag oder nur eine bestimmte Zahl von Lichtbögen bzw. Durchschlägen aufgetreten ist.

22. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 18 bis 21,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Steuer- und Regelungseinheit die Einschaltdauer bis zum CW-Betrieb verlängern kann.
23. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 18 bis 22,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Steuer- bzw. Regeleinheit (4) beim Beginn des Plasmabetriebs die an die Elektroden (Kathode K, GND) angelegte Spannung entweder dauernd oder für eine bestimmte Einschaltdauer einschaltet, dann für eine bestimmte Ausschaltdauer ab- oder bevorzugt umschaltet, und sodann die Spannung wieder einschaltet, und daß die Steuer- bzw. Regeleinheit beim Auftreten von Lichtbögen bzw. Durchschlägen die Einschaltdauer der Spannung verringert.
24. Versorgungseinheit nach Anspruch 23,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die anfänglichen Werte der Einschaltdauer und der Ausschaltdauer und/oder die Zahl von Lichtbögen bzw. Durchschlägen sowie die Zeiteinheit, in denen diese Zahl auftritt, einstellbar sind.

25. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 18 bis 24,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Einschaltdauer mit der Häufigkeit des Auftretens von Lichtbögen bzw. Durchschlägen über eine variable Kennlinie verknüpft ist, die von weiteren Prozeßparametern abhängig sein kann.
26. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 15 bis 25,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Steuer- bzw. Regeleinheit die Ausschaltdauer optimiert.
27. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 15 bis 26,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß die Steuer- bzw. Regeleinheit (4) Bestandteil der Schaltung (3) zum Erkennen von Lichtbögen ist.
28. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 15 bis 27,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß eine Vorgabeeinheit (5) vorgesehen ist, mit der Startwerte und/oder Kennlinien einstellbar sind.
29. Versorgungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis 28,  
dadurch **gekennzeichnet**, daß sie zwischen wenigstens zwei der vorstehend beschriebenen Betriebsmodi - schnelles Abschalten nur beim Auftreten von Arcs, periodisches Aus- bzw. Umschalten, adaptive Regelung etc. - umschaltbar ist.

FIG 1

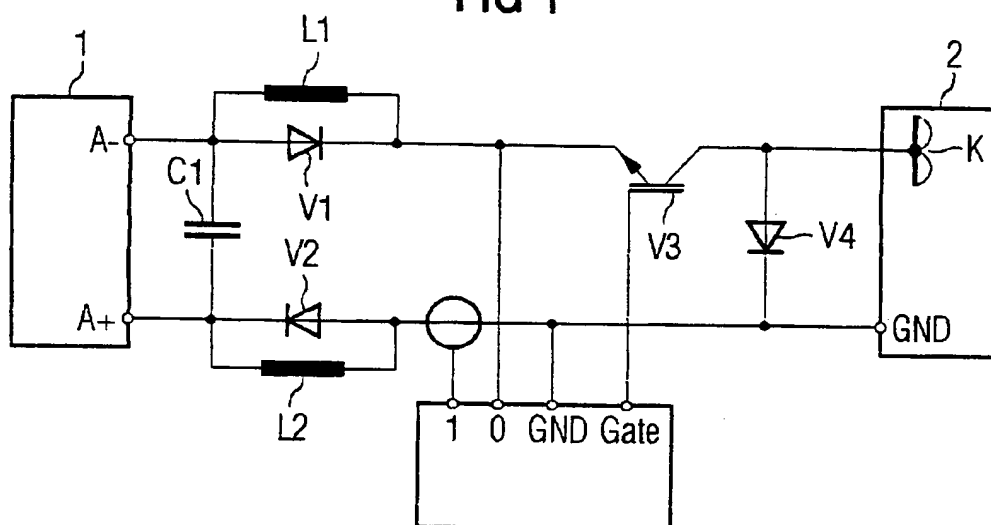
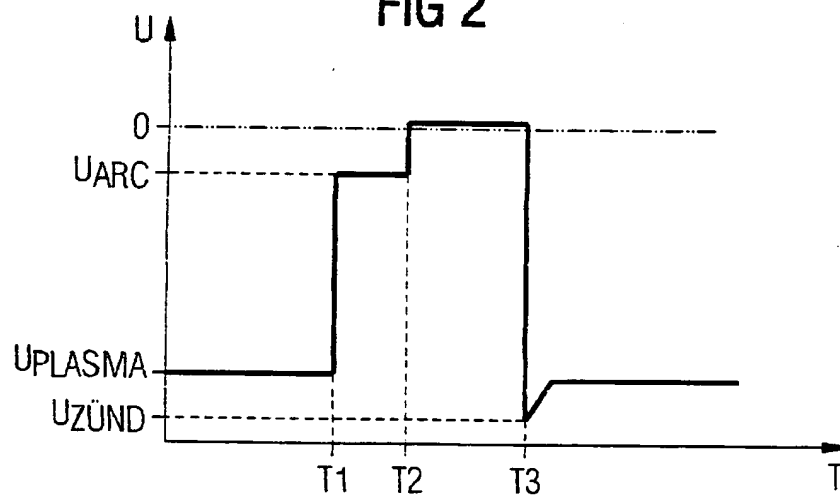


FIG 2



2/4

FIG 3

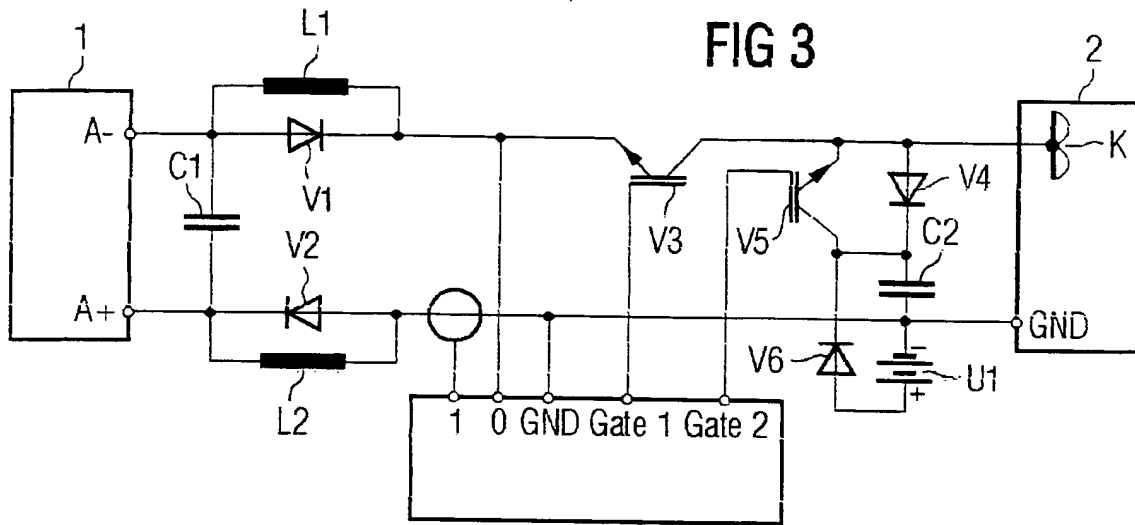


FIG 4

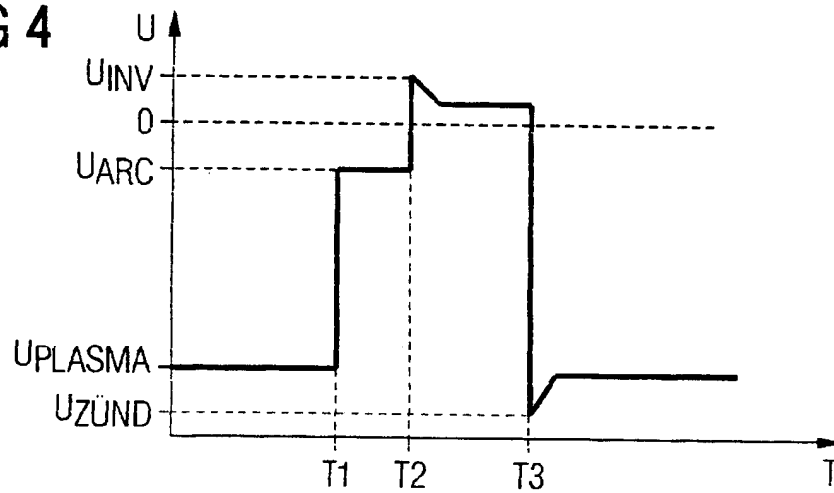


FIG 5

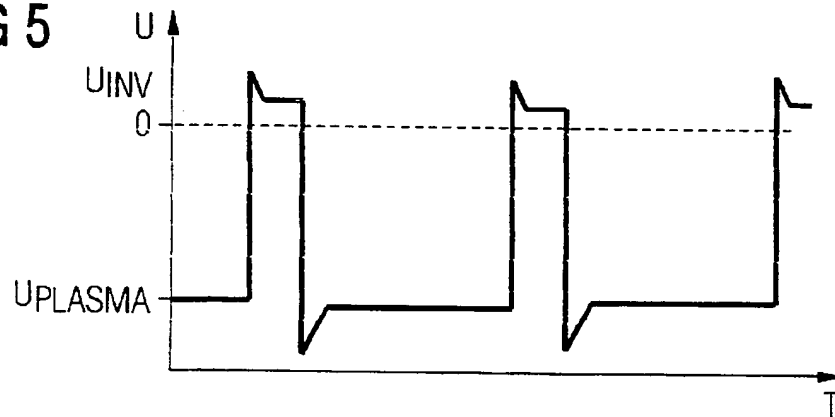


FIG 6

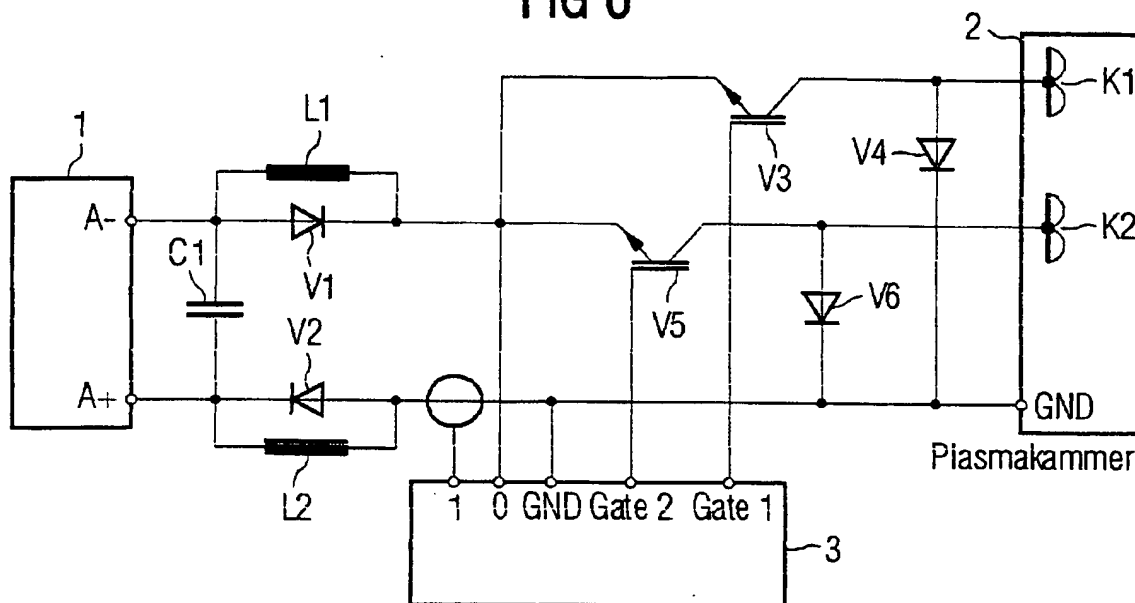


FIG 7

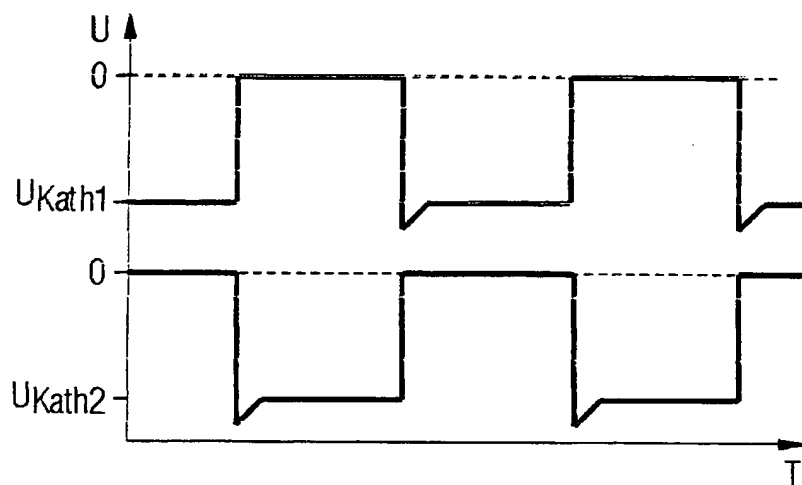


FIG 8

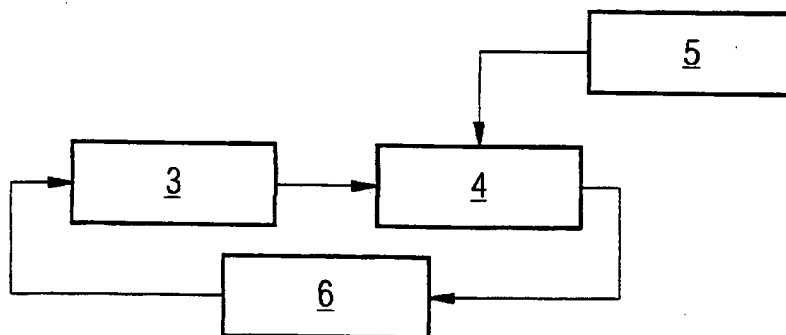
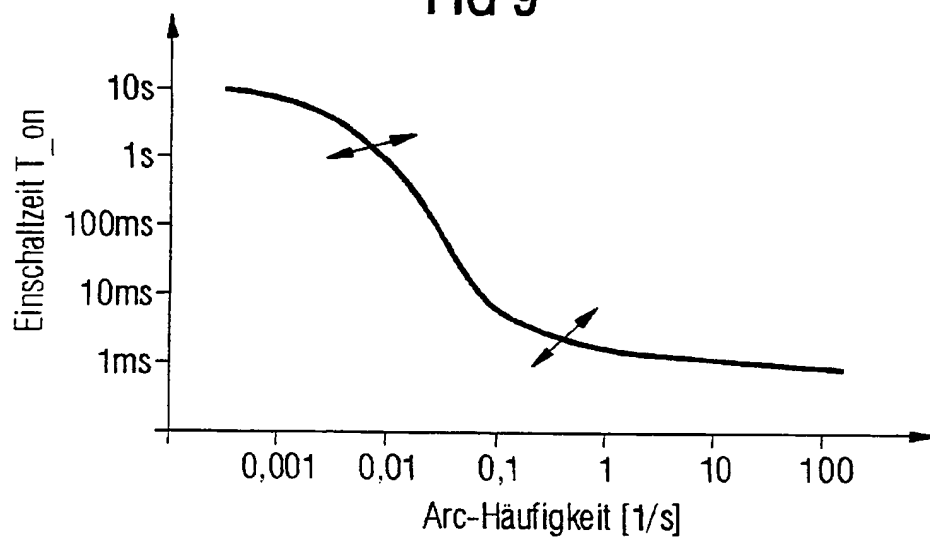


FIG 9





# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 00/02741

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 H01J37/32

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 H01J

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 97 49267 A (SIERRA APPLIED SCIENCES INC) 24 December 1997 (1997-12-24) page 4, line 18 -page 7, line 28; figure 1 ---	1-4,6,9
Y	US 5 303 139 A (MARK GUNTER) 12 April 1994 (1994-04-12) column 2, line 40 -column 3, line 25; figure 1 ---	1-4,6,9
P,A	EP 1 013 792 A (SHIBAURA MECHATRONICS CORP) 28 June 2000 (2000-06-28) column 3, line 10 -column 9, line 34; figure 1 & WO 98 37257 A (FUJI TAKASHI ET AL) 27 August 1998 (1998-08-27) --- -/--	1-29



Further documents are listed in the continuation of box C.



Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*G\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

4 January 2001

Date of mailing of the international search report

16/01/2001

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Schaub, G

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Application No

PCT/DE 00/02741

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 5 889 391 A (COLEMAN CHARLES) 30 March 1999 (1999-03-30) abstract; figures ---	3-6, 9-29
A	US 5 682 067 A (BILLINGS KEITH H ET AL) 28 October 1997 (1997-10-28) cited in the application column 3, line 30 -column 6, line 44; figures 1,2 ---	1, 3-6, 9, 10, 15-17, 29
A	EP 0 592 164 A (PICKER INT INC) 13 April 1994 (1994-04-13) column 2, line 55 -column 4, line 17; figure 1 -----	1

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 00/02741

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9749267 A	24-12-1997	US 5882492 A AU 3390897 A	16-03-1999 07-01-1998
US 5303139 A	12-04-1994	DE 9109503 U AT 135857 T DE 59205745 D EP 0534068 A ES 2088050 T JP 6113561 A	17-10-1991 15-04-1996 25-04-1996 31-03-1993 01-08-1996 22-04-1994
EP 1013792 A	28-06-2000	CN 1248299 T JP 2835323 B JP 10298755 A WO 9837257 A	22-03-2000 14-12-1998 10-11-1998 27-08-1998
US 5889391 A	30-03-1999	US 5990668 A	23-11-1999
US 5682067 A	28-10-1997	AU 3234997 A EP 0906716 A JP 2000513133 T WO 9749268 A US 5815388 A	07-01-1998 07-04-1999 03-10-2000 24-12-1997 29-09-1998
EP 0592164 A	13-04-1994	US 5347571 A DE 69315410 D DE 69315410 T	13-09-1994 08-01-1998 19-03-1998

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/02741

## A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

IPK 7 H01J37/32

Nach der internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 H01J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

WPI Data, PAJ, EPO-Internal

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 97 49267 A (SIERRA APPLIED SCIENCES INC) 24. Dezember 1997 (1997-12-24) Seite 4, Zeile 18 -Seite 7, Zeile 28; Abbildung 1	1-4,6,9
Y	US 5 303 139 A (MARK GUNTER) 12. April 1994 (1994-04-12) Spalte 2, Zeile 40 -Spalte 3, Zeile 25; Abbildung 1	1-4,6,9
P,A	EP 1 013 792 A (SHIBAURA MECHATRONICS CORP) 28. Juni 2000 (2000-06-28) Spalte 3, Zeile 10 -Spalte 9, Zeile 34; Abbildung 1 & WO 98 37257 A (FUJI TAKASHI ET AL) 27. August 1998 (1998-08-27)	1-29
	--- -/--	



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*Z\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

4. Januar 2001

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

16/01/2001

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Schaub, G

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/02741

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 5 889 391 A (COLEMAN CHARLES) 30. März 1999 (1999-03-30) Zusammenfassung; Abbildungen ----	3-6,9-29
A	US 5 682 067 A (BILLINGS KEITH H ET AL) 28. Oktober 1997 (1997-10-28) in der Anmeldung erwähnt Spalte 3, Zeile 30 -Spalte 6, Zeile 44; Abbildungen 1,2 -----	1,3-6,9, 10, 15-17,29
A	EP 0 592 164 A (PICKER INT INC) 13. April 1994 (1994-04-13) Spalte 2, Zeile 55 -Spalte 4, Zeile 17; Abbildung 1 -----	1

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 00/02741

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9749267 A	24-12-1997	US 5882492 A AU 3390897 A	16-03-1999 07-01-1998
US 5303139 A	12-04-1994	DE 9109503 U AT 135857 T DE 59205745 D EP 0534068 A ES 2088050 T JP 6113561 A	17-10-1991 15-04-1996 25-04-1996 31-03-1993 01-08-1996 22-04-1994
EP 1013792 A	28-06-2000	CN 1248299 T JP 2835323 B JP 10298755 A WO 9837257 A	22-03-2000 14-12-1998 10-11-1998 27-08-1998
US 5889391 A	30-03-1999	US 5990668 A	23-11-1999
US 5682067 A	28-10-1997	AU 3234997 A EP 0906716 A JP 2000513133 T WO 9749268 A US 5815388 A	07-01-1998 07-04-1999 03-10-2000 24-12-1997 29-09-1998
EP 0592164 A	13-04-1994	US 5347571 A DE 69315410 D DE 69315410 T	13-09-1994 08-01-1998 19-03-1998